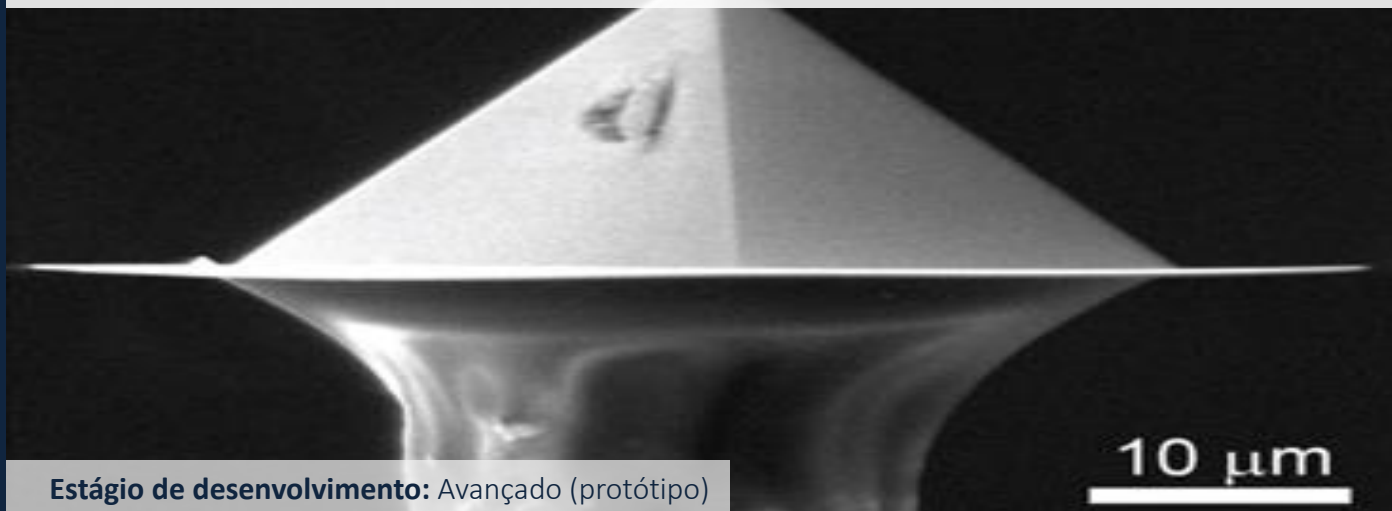


RESUMO DE TECNOLOGIA CTIT-UFMG

Engenharia

Coordenadoria de Transferência e Inovação Tecnológica CTIT - UFMG

MÉTODO E EQUIPAMENTO DE POSICIONAMENTO AUTOMÁTICO PARA MICROSCOPIA POR VARREDURA DE SONDA E ESPECTROSCOPIA ÓPTICA IN SITU



Estágio de desenvolvimento: Avançado (protótipo)

Descrição

Método e um equipamento capazes de posicionar automaticamente uma sonda usada para procedimentos de microscopia de varredura por sonda (*Scanning Probe Microscopy* ou *SPM*). Experimentos de microscopia de varredura são úteis em indústrias de manufatura de precisão, microeletrônica e biomédica, dentre outras áreas de ciência e tecnologia em que tal monitoramento resulta em uma melhora de qualidade e confiabilidade dos produtos.

Vantagens

- Descarta a necessidade da presença de um especialista dedicado e as desvantagens associadas ao posicionamento manual.
- Propicia maior repetibilidade, confiabilidade, rapidez e robustez aos experimentos, devido ao posicionamento automático.

Inventores

Ado Jorio de Vasconcelos, Laura Pinto Coelho Amorim, Hudson Luiz Silva de Miranda, Johnathan Mayke Melo Neto, Luiz Fernando Etrusco Moreira, Luiz Gustavo Cançado, Cassiano Rabelo e Silva.

Titulares:

- UFMG

Nº da PI: BR1020150112335

TRANSFERENCIA@CTIT.UFMG.BR
+55 31 3409-3929

UF *m* G

 CTIT
Coordenadoria de
Transferência e
Inovação Tecnológica